第2期 2001年4月 高分子学报 ACTA POL YMERICA SINICA

No. 2 Apr., 2001

甲壳素类液晶高分子的研究

V. 取代基个数及长度对羟乙基壳聚糖液晶性的综合影响^{*}

董炎明** 吴玉松 王 勉

(厦门大学材料科学系和固体表面物理化学国家重点实验室 厦门 361005)

摘 要采用碱壳聚糖的方法合成了一系列具有不同摩尔醚化度(DME)的新的液晶性壳聚糖衍生物羟乙基 壳聚糖(HECS).用酸氧化蚀刻的方法,在扫描电子显微镜(SEM)下证实了其胆甾型的液晶织构.以甲酸为溶 剂,研究了摩尔醚化度对羟乙基壳聚糖溶致液晶性的影响.结果表明,在该体系中,摩尔醚化度能综合取代基 个数及长度两个结构因素的影响,当 DME 较低时(<~2.0),这种影响关系类似于取代基个数(即取代度)的 影响,当 DME 较高时(>~2.0),则类似于取代基长度的影响.前者对液晶临界浓度的影响很小,而后者却有 显著影响.此外还观察到当 DME >~2.0时出现水溶性,HECS 的水溶液也呈现典型的胆甾指纹状织构. 关键词 羟乙基壳聚糖,溶致液晶,摩尔醚化度,胆甾相,蚀刻,扫描电子显微术

壳聚糖是甲壳素的脱乙酰化产物,其结构类 似于纤维素,可看成是纤维素 C₂ 位上的一OH被 一NH₂取代后的产物.正因为其结构的复杂性,可 对壳聚糖进行多种不同的化学修饰,如羧酰 化^[1,2]、醚化^[3]、N-酰化^[4~6]等.这些丰富的化学 修饰方法为研究壳聚糖及其衍生物的液晶性提供 了很好的条件.

前文^[7~11]中,作者已较系统地研究了分子 量、取代度、侧基长度及脱乙酰度等结构因素对壳 聚糖及其衍生物液晶行为的影响,但只是分别在 不同的体系中研究这些结构因素的影响.本文合 成了一类新的具有液晶性的壳聚糖羟烷基化衍生 物——羟乙基壳聚糖,由于其独特的结构特点,能 够在同一体系中综合取代基个数和长度两个结构 因素对其液晶性的影响,从而使壳聚糖及其衍生 物的液晶行为能得到更深入的认识.

1 实验部分

1.1 材料和仪器

壳聚糖为厦门第二制药厂生产,脱乙酰度(碱 量法)为 84 %,分子量(粘度法)为 7.4 ×10⁵.

元素分析仪为意大利 CE 1110 Chns-O;核磁 共振仪为美国 Varian Unity 500Hz;富立叶红外 光谱仪为美国 Nicolet Avator 360;偏光显微镜 (POM)为日本 Olympus BHT;扫描电子显微镜 (SEM)为日本 Hitachi S-520.

1.2 羟乙基壳聚糖的合成

 1.2.1 碱壳聚糖的制备 称取 2.0g 壳聚糖, 投入到 10mL 13 % NaOH 水溶液中,搅拌均匀, 于室温下反应 2h,让其充分溶胀后,于 - 18 冰 柜中放置过夜.

1.2.2 不同摩尔醚化度羟乙基壳聚糖的制备

往上述碱壳聚糖中加入一定量的环氧乙烷(预 先冷却至 0 以下),在冰水浴(0~5)下搅拌 2h,提高温度至 35 ,继续反应一定时间.冷却 后,以盐酸中和,并在丙酮中沉淀,过滤后烘干得 产物.不同摩尔醚化度的羟乙基壳聚糖合成条件 如表 1 所示.

 Table 1
 Preparation condition of hydroxyethyl chitosan (HECS)

 with different value of degree of molar etherification (DME)

G 1	Ethylene oxide	Reaction time(h)	
Sample	(mL)	0~5	35
HECS1	10	2	10min
HECS2	10	2	1
HECS3	10	2	2
HECS4	20	2	2
HECS5	20	2	4
HECS6	20	2	6
HECS7	20	2	10

1.3 临界浓度的测定方法

在小称量瓶中配制以1%间隔递增的一系列

*2000-03-20 收稿,2000-08-03 修稿;国家自然科学基金(基金号 29974023)和福建省自然科学基金(基金号 Z9910006)资助项目; **通讯联系人 观察到双折射的浓度为临界浓度.

1.4 胆甾型液晶织构的氧化酸蚀刻方法

配制 15%(大于临界浓度)的 HECS3/丙烯酸/水溶液(丙烯酸 水=71),添加约含溶剂量5% 的安息香乙醚,溶解均匀后置于暗处放置4天.取 少量的溶液夹于两小片(约0.8×0.8cm)玻片之 间压成薄膜.然后暴露在阳光下约5min 使溶液固 化.用刀片分开玻片,得到含羟乙基壳聚糖胆甾液 晶织构的 HECS3/聚丙烯酸(PAA)固化膜.将固 化膜在1%高锰酸钾的 H₂SO₄H₃PO₄=21混合

玻片之间形成液晶盒,以20 下偏光显微镜刚能

酸溶液中蚀刻 45min,而后依次用 10%过氧化氢 溶液、蒸馏水和乙醇洗净,于 50 左右烘干,得到 SEM 观察的样品.

2 结果与讨论

2.1 合成产物的结构表征

原料壳聚糖分子结构单元中存在 C₃ 和 C₆ 两 个──OH 基团,如图 1(a)。理论上这两个羟基均 可发生醚化,同时,产物羟乙基壳聚糖仍可继续进 行醚化.因此,每个葡萄糖单元上接上的环氧乙烷 的数目(即摩尔醚化度,简称 DME)可大于 2,如 图 1(b)所示.



Fig. 1 Chemical structure of chitosan and hydroxyethyl chitosan

比较原料与产物 (DME = 4.3) 的红外谱图 (图 2),产物在 2924cm⁻¹(一CH₂—伸缩振动)、 1453cm⁻¹和 1410cm⁻¹(一CH₂—变形振动)及 867cm⁻¹(一CH₂—长链摇摆)处有非常突出的吸 收,这是由于醚化后壳聚糖侧基中引入了羟烷基 而带进的大量—CH₂的缘故.3405cm⁻¹仍有很强 的吸收,说明羟乙基壳聚糖保留有许多羟基.同 时,原壳聚糖 1152cm⁻¹谱带位移到 1112cm⁻¹.这 是由于出现了一类新的C一O一C桥键,与原 C一O一C桥键(1152cm⁻¹)的吸收合并的结果.原 壳聚糖一级醇羟基C一O伸缩振动(1035cm⁻¹)和 二级醇羟基的C一O伸缩振动(1079cm⁻¹)却不见 了,而新出现的 1066cm⁻¹应对应于取代基端羟基 的C[—]O伸缩振动.这些说明了壳聚糖已被羟乙基 化,C₃和 C₆都有取代.

各样品(为 HECS1 ~ HECS7) 经元素分析计 算的 DME 值(计算中考虑了原料的脱乙酰度以 及吸附水)分别为 0.2、1.1、1.9、2.5、2.8、4.3、 5.4.

以含 5 % CF₃COOH 的 D₂O 为溶剂,D₂O 为 内标,用¹H-NMR 来进一步证实其中一个样品 (HECS2)的摩尔醚化度(见图 3).各峰具体归属 见表 2.以下式计算其 DME 值为 1.2,与元素分 析的结果(1.1)相符.

 $DME = I_{H7 \sim 8} / 2 I_{H6}$

2.2 羟乙基壳聚糖的液晶态织构

壳聚糖衍生物液晶大多数为胆甾型的织构, 羟乙基壳聚糖也不例外.所有不同 DME 样品的 甲酸溶液均可在偏光显微镜中观察到胆甾型液晶 典型的指纹状织构(见图 4a).同时,由于侧基上



Fig. 2 FTIR spectra of CS and HECS6

引入亲水基团,当摩尔醚化度大于1.9时,衍生物 出现水溶性,且在水溶液中呈现液晶性(见图 4b).



Fig. 3 ¹H-NMR spectra of HECS2

Table 2 Chemical shifts of different kinds of protons in I	HECS2
--------------------------------------------------------------------	-------

Chemical shifts	Protons	
1.87	N-Acetyl	
3.00 ~ 3.22	H3 ,4 ,5	
3.52	H6	
3.55~3.88	H7 ,8	
4.66	H2	
4.84	H ₂ O	



Fig. 4 POM photograph of cholesteric liquid crystal texture of HECS solutiona) HECS4 in 30 % formic acid solution;b) HECS7 in 18 % aqueous solution

偏光显微镜只是从光学的角度来间接理解所 观察物的内部织构,而扫描电镜则可通过对样品 表面的直接观察来反映其内部织构.样品经氧化 酸蚀刻可以增加衬度,图5就是这一蚀刻机理的 示意图,图中短线代表分子链,钉子状代表倾斜的 分子链,点代表分子链端,圆圈代表被蚀刻过的链 端. 当含指纹织构的 HECS/ PAA 固化膜用氧化酸 进行蚀刻时,由于表面分子排列方式的不同,平躺 于表面的分子与蚀刻剂反应后发生断链,产生的 分子碎片被溶解,从而易于蚀刻;而垂直于表面的 分子由于与蚀刻剂反应后在末端多半形成羧基, 阻止了进一步的反应. 蚀刻的结果是在膜表面出 现反映层状胆甾织构的表面地理.图6是经酸蚀 刻后的样品的 SEM 照片. 从照片上可以清楚地 看到蚀刻以后留下的指纹状织构,从而得到了这 种胆甾型液晶织构的更直接的证据.



Fig. 5 Model of the mechanism for permanganic etching of HECS cholesteric phase



Fig. 6 SEM photograph of HPCS3/ PAA composite

2.3 取代基个数和长度对临界浓度的影响

临界浓度是溶致液晶的重要参数,常用干衡 量溶致液晶性的优劣.图7给出了 HECS/ FA 溶 液中测定的液晶临界浓度 (c^*) 与 DME 的关系. 显然,较低的摩尔醚化度(DME=0.2)就使得 c^* 显著上升.之后,在较大的范围(0.2~1.9)内曲线 斜率很小,表明此时 DME 对 c^{*}影响很小.而当 DME大于 1.9 时, c^* 值又随 DME 的增加而明显 增大.这种复杂的影响规律综合了取代基个数(即 取代度)和取代基长度两个结构因素的影响,同前 文^[8~10]其他体系的单独研究结果(取代度影响不 大而柔性取代基长度影响较大)一致,事实上,当 取代程度较低的情况下,醚化反应主要发生在环 上.DME的影响相当于取代基个数的影响:随着 取代程度的不断提高,醚化反应则主要发生在羟 乙基壳聚糖的侧基上.这样,随着 DME 增大,侧 基不断延长,DME的影响相当于取代基长度的影 响.



Fig. 7 The relation between degree of molar etherification and critical concentration of HECS/ formic acid solution

对刚性高分子,临界浓度值与构象持续长度 (q)和分子直径(d)有关.根据 Flory 的半经验公 式⁽¹²⁾:

$$c^{*} = (8/x)(1 - 2/x)$$



Fig. 8 Schematic illustration of the increase of HECS molecular diameter with enhancement of DME

其中, x 为分子的轴比,其值等于 2 q/ d.

当 $q \gg d$,该式可近似为:

 c^* 4 d/q

也就是说, c^* 与 d 值成正比, 而与 q 值成反比.

显然,随着 DME 的增加, q 会减小,从而 c^* 值提高.较小的取代就能使分子的规整性以及原 分子内和分子间氢键有较大程度的破坏,从而 DME = 0.2 就使 c^* 大为增加.但 DME 小于 2 时,取代基较短,进一步增加 DME 对柔性增加不 显著.只有当 DME 大于 2 时,长的柔性取代基使 q 值明显降低,而使 c^* 又迅速增加.

另一方面,随着 DME 的增加, *d* 将发生变化 (如图 8 所示).只需较低的 DME 就可使 *d* 显著 变大.之后,由于醚化反应主要发生在环上, *d* 基 本不变,直至环上羟基完全被取代(此时 DME = 2).随着 DME 的进一步增加,分子又开始变 "胖",而 *d* 值的变化是导致 *c*^{*}变化的另一原因.

REFERENCES

- 1 Grant S, Bair H S, Mckay G. Makromol Chem, 1989, 190:2279 ~ 2286
- 2 Grant S, Bair H S, Mckay G. Polymer Communications, 1988, 29:342 ~ 344
- 3 Wang Aiqing(王爱勤), Yu Shenda(俞肾达). J Functional Polym(功能高分子学报), 1998, 11(1):81
- 4 Rout D K, Pulapura S K, Gross R A. Macromolecules ,1993 ,26(22) :5999 ~ 6010
- 5 Rout D K,Barman S P,Pulapura S K,Gross R A. Macromolecules ,1994 ,27(11) :2945 ~ 2950
- 6 Dong Y M ,Li Z Q. Chinese J of Polym Sci ,1999 ,17(1) :65 ~ 70
- 7 Wang Jianwei (汪剑炜), Dong Yanming (董炎明), Liu Huangnan (刘晃南), Yuan Qing (袁清), Mei Xuefeng (梅雪峰). Chemical Journal of Chinese University (高等学校化学学报), 1999, 20(3): 474~477
- 8 Dong Yanming(董炎明), Wang Jianwei(汪剑炜), Wu Zhifu(吴智福), Mei Xuefeng(梅雪峰), Yuan Qing(袁清), Liu Huangnan(刘晃南). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 1999, (5):576~580
- 9 Dong Yanming(董炎明), Wang Jianwei(汪剑炜), Mei Xuefeng(梅雪峰), Wu Zhifu(吴智福), Yuan Qing(袁清), Liu Huangnan(刘晃南). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 1999, (6):668~673
- 10 Yuan Qing(袁清), Dong Yanming(董炎明), Wang Jianwei(汪剑炜), Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2000, (1):5~8
- 11 Wang Jianwei (汪剑炜), Dong Yuanming (董炎明), Li Xusheng (李旭升). Acta Polymerica Sinica (高分子学报), 2000, (6):732~735
- 12 Flory P.J. Proc R Soc London Ser A, 1956, 234:60 ~ 72

STUDIES ON CHITIN BASED LIQUID CRYSTALLINE POLYMERS V. INTEGRATED INFLUENCE OF NUMBER AND LENGTH OF SUBSTITUENT ON HYDROXYETHYL CHITOSAN

DONG Yanming, WU Yusong, WANG Mian

(Department of Materials Science and State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces, Xiamen University, Xiamen 361005)

Abstract A novel liquid crystalline polymer — hydroxyethyl chitosan (HECS) was synthesized in alkali system. The degree of molar etherification (DME) of HECS was controlled by both the amounts of ethylene oxide and the reaction time. DME of HECS specimens was from 0.2 to 5.4 measured by element analysis and NMR. All specimens formed typical cholesteric texture — fingerprint texture while dissolved in formic acid. HECS with DME > 1.9 was water soluble, and the HECS aqueous solution also formed cholesteric phase with typical texture. The mesophase texture was detected both by polarized optical microscopy and scanning electron microscopy. Samples for SEM studies were treated by permanganic etching in order to increase the contrast. The studies were focused on the effect of DME on the critical concentration (c^*) of mesophase formation for HECS/formic acid solutions. The results indicated that c^* sharply increased with DME at first and became independent as DME varied from 0.2 to 1.9. After that (DME > 1.9), it regain obvious rise as DME continuously heightened. These results were explained by the variation of both persistence length q and molecular diameter d in Flory's semi-experience equation $c^* = 8 q/x$ (x = 2 q/d). The variation of DME of HECS related with two structural factors ,i. e. the number and length of the substituent, the former affected c^* slightly, but the latter affected c^* evidently.

Key words Hydroxyethyl chtiosan, Lyotropic liquid crystal, Degree of molar etherification, Cholesteric, Etching, Scanning electron microscopy